

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

А В Т О М Е Т Р И Я

№ 4

1999

УДК 535.39

В. Г. Половинкин, С. Н. Свиташева

(Новосибирск)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА РЕШЕНИЙ
ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ЭЛЛИПСОМЕТРИИ
В ЗАДАННОЙ ОБЛАСТИ ПАРАМЕТРОВ

Предложен метод, позволяющий, не решая основного уравнения эллипсометрии, определить общее число решений обратной задачи эллипсометрии (ОЗЭ) для конкретной точки $\Psi-\Delta$ плоскости для однослойной системы среда–поглощающая пленка–поглощающая подложка в заданной области искомых параметров. Метод основан на использовании свойств относительного коэффициента отражения ρ как аналитической функции комплексного переменного. При решении ОЗЭ применение метода позволяет контролировать полноту найденных решений в заданной области.

Введение. Эллипсометрический метод интенсивно развивается, особенно в последнее десятилетие, и, прежде всего, как неразрушающий метод контроля в самых различных отраслях знаний. Например, спектральная эллипсометрия широко используется для контроля и анализа состава материалов, синтезируемых методом молекулярно-лучевой эпитаксии [1], разностно-анизотропная эллипсометрия (RDS или RAS) – для анализа реконструкции атомарно-чистой поверхности [2], отображающая эллипсометрия – для визуализации взаимодействия белковых объектов [3] и т. д.

Вопрос однозначности интерпретации эллипсометрических измерений остается одним из важнейших вопросов, определяющим не только точность и достоверность полученной информации, но и в итоге дальнейшее распространение метода.

Известно, что прямая задача всегда однозначна: данному набору параметров исследуемой системы соответствует единственное значение относительного коэффициента отражения ρ и, следовательно, единственная точка на плоскости $\Psi-\Delta$.

Для обратной задачи ситуация значительно сложнее. Ранее [4–10] было показано, что даже для простой однослойной системы среда–пленка–подложка существует неоднозначность решения обратной задачи эллипсометрии. Для каждой точки плоскости $\Psi-\Delta$ в пространстве параметров пленки (n_1, k_1, d_1) существуют семейства кривых, каждая точка которых является точным решением основного уравнения эллипсометрии:

$$\rho = \frac{R_p}{R_s} \equiv \operatorname{tg} \Psi \exp(i\Delta). \quad (1)$$

Решая ОЗЭ, исследователь обычно имеет априорную информацию о допустимой области значений параметров. В эту область из всего множества возможных решений может попасть только конечное их число (в том числе и нулевое). Не зная количества решений в заданной области, исследователь может ограничиться анализом только некоторых из них и сделать неверные выводы.

Целью данной работы является поиск метода определения числа решений в заданной области параметров пленки.

В первой части работы на примере однослоиной системы воздух–пленка–подложка рассмотрено отображение заданной области параметров пленки ($n_1 - k_1$) на плоскость эллипсометрических углов Ψ и Δ . Показано существование областей значений углов Ψ и Δ с различным числом решений.

Во второй части работы предложен метод определения числа решений основного уравнения эллипсометрии в заданной области параметров пленки при помощи таких отображений.

1. Отображение области параметров пленки на плоскость эллипсометрических углов. Одним из первых для решения ОЗЭ применялся графоаналитический метод или метод номограмм, предложенный Арчером [11]. В этом методе заданная область $d_1 - n_1$ плоскости параметров прозрачной пленки ($k_1 = 0$) отображается на плоскость эллипсометрических углов Ψ и Δ . Прямые линии равного показателя преломления n_1 отображаются на $\Psi - \Delta$ плоскость в виде замкнутых криволинейных контуров, а линии равной толщины пленки d_1 – в виде семейства кривых, пересекающих эти контуры.

Для поглощающих пленок можно получить аналогичные номограммы, зафиксировав значение одного из трех параметров пленки (n_1 , k_1 или d_1) и изменяя значения двух других параметров. В данной работе мы предлагаем фиксировать значение нормализованной толщины пленки: $t_1 = 2\pi d_1 / \lambda$, где λ – длина волны падающего излучения. При $\lambda = 632,8$ нм и толщине $d_1 = 100$ нм получим $t_1 = 0,993 \approx 1$.

Рассмотрим несколько примеров отображения области, заданной на плоскости $\text{Re}(N_1) - \text{Im}(N_1)$, на плоскость $\Psi - \Delta$ для однослоиной системы воздух ($N_0 = 1$) – поглощающая пленка (d_1 , $N_1 = n_1 - ik_1$) – поглощающая подложка ($N_S = N_{Si} = 3,865 - i0,023$). Угол падения света $\phi_0 = 70^\circ$. При $t_1 = 0,4$ сетка ортогональных линий равного показателя преломления ($n_1 \in 2,0 - 4,0$) и равного коэффициента экстинкции ($k_1 \in 0 - 2,0$), показанная на рис. 1, a, отобразится криволинейной сеткой на плоскость $\Psi - \Delta$ (рис. 1, b). Если точка A на рис. 1, a попадает в одну из этих ячеек, то соответствующая ей точка на плоскости $\Psi - \Delta$ будет принадлежать соответствующей ячейке сетки на рис. 1, b и наоборот. Таким образом, каждой точке внутри контура 1–2–3–4–1 на рис. 1, b соответствует единственное решение в прямоугольнике 1–2–3–4 на рис. 1, a.

Если область значений n_1 и k_1 увеличить как показано на рис. 2, a, то на ее отображении на плоскость $\Psi - \Delta$ (рис. 2, b) появится область 5–1–5 с двойной сеткой линий $n_1 = \text{const}$ и $k_1 = \text{const}$. Это означает, что каждой точке A внутри контура 5–1–5 на плоскости $\Psi - \Delta$ соответствуют две точки A и A' на плоскости $\text{Re}(N_1) - \text{Im}(N_1)$ в области, ограниченной контуром 1–5–1'-5' (см. рис. 2, a). Для точек вне контура 5–2–3–4–5 на плоскости $\Psi - \Delta$ нет решений в заданной области 1–2–3–4–1 на плоскости $\text{Re}(N_1) - \text{Im}(N_1)$.

Для пленок с большей толщиной ($t_1 = 1$) карта углов Ψ и Δ становится более сложной. Из рис. 3, a и b видно, что область, ограниченная прямоуголь-

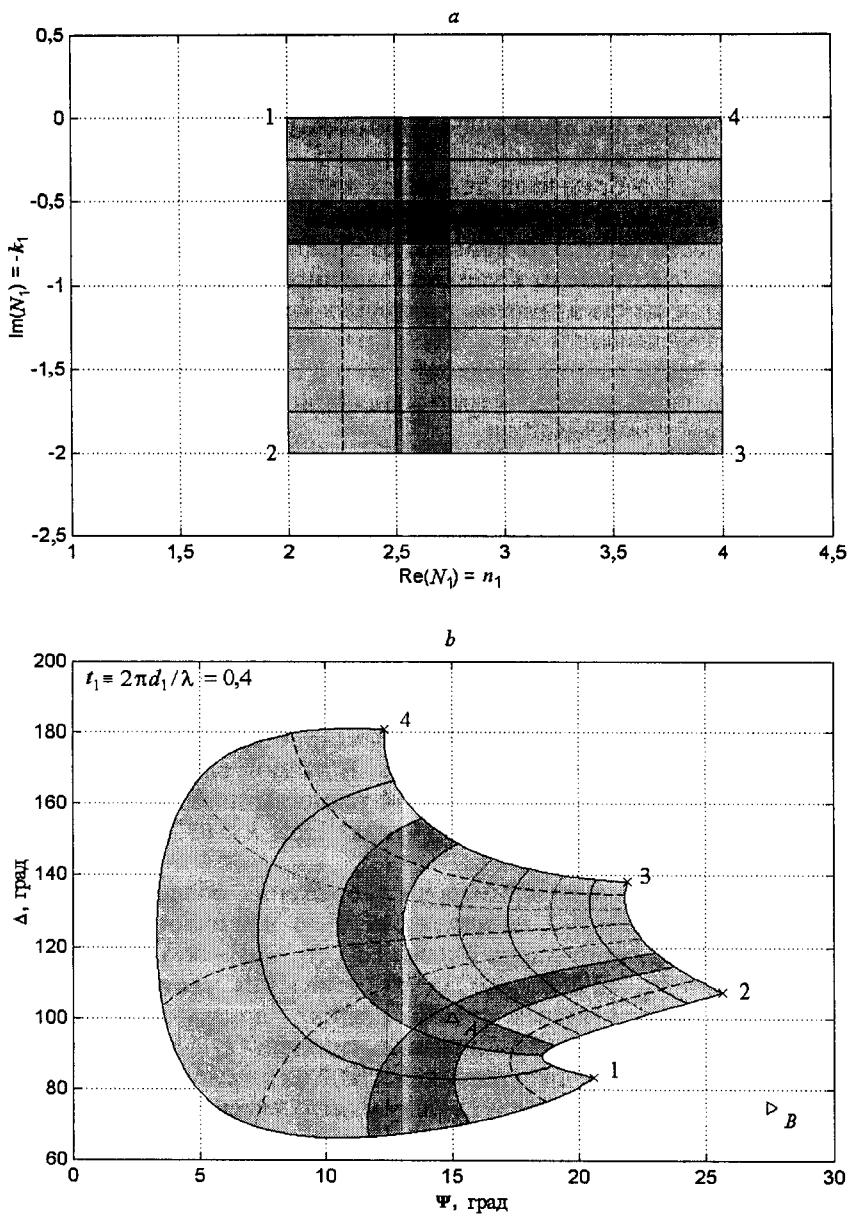


Рис. 1

ным контуром 1–2–3–4 на плоскости $\text{Re}(N_1)$ – $\text{Im}(N_1)$, отображается в область, ограниченную криволинейным контуром 1–5–5'–6–4–3–7–1 на плоскости Ψ – Δ и содержащую две внутренние области: 6–6' (в увеличенном масштабе показана на вставке) и 7–2–7'. Для точек D и B этих внутренних областей существует по два прообраза (точки D , D' и B , B') в областях, ограниченных контурами 6–6'–6 и 7–2–7'–2'–7 соответственно. Для точки A на плоскости Ψ – Δ существует только одно решение, а для точки C нет ни

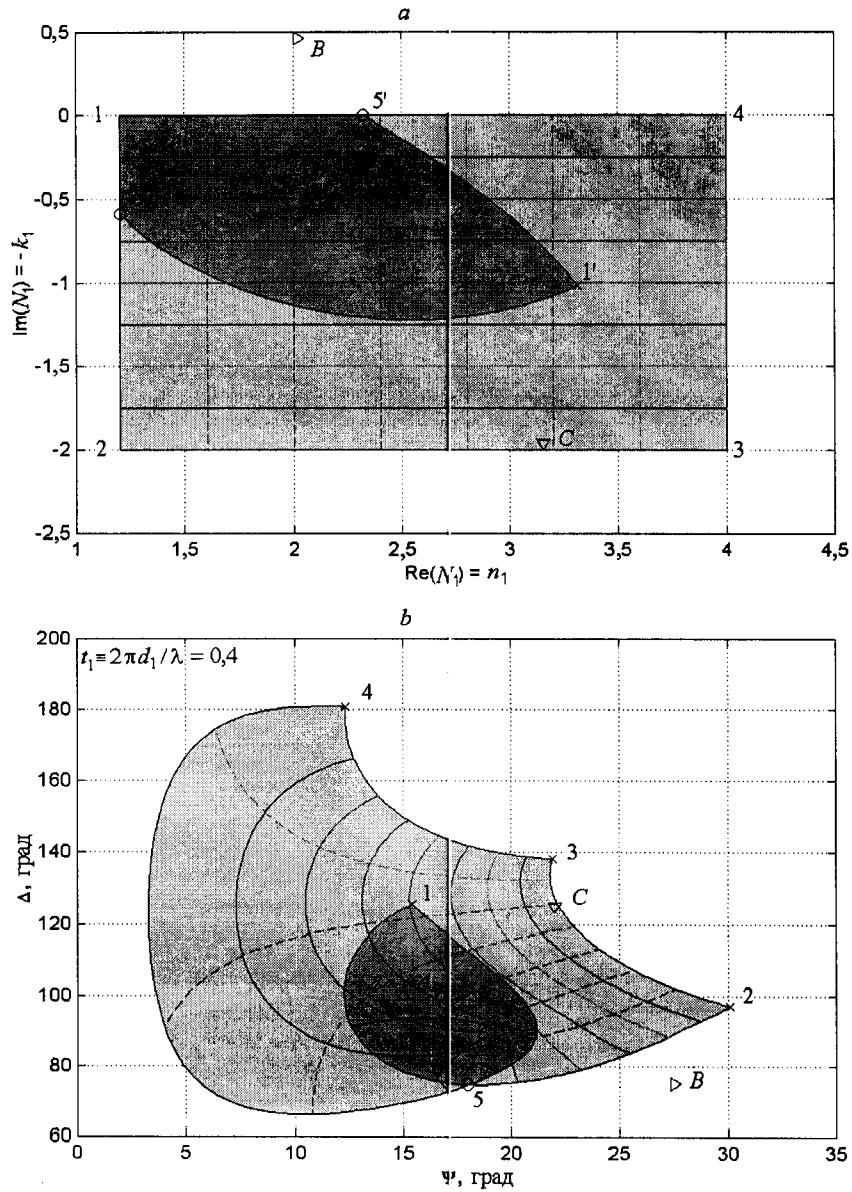


Рис. 2

одного решения в заданной области на плоскости $\text{Re}(N_1)$ – $\text{Im}(N_1)$, как видно из рис. 3, а.

Использование эллипсометрических координат Ψ и Δ имеет определенное неудобство, связанное с наличием «искусственного» разрыва в точке, где фаза относительного коэффициента отражения ρ проходит через 0 или 2π , т. е. $\Delta = 0^\circ$ или $\Delta = 360^\circ$ (точки 5 и 5' на рис. 3, б). Этот разрыв исчезает, если использовать полярные координаты: $\rho = \text{tg} \Psi e^{i\Delta}$. На рис. 4 показана в таких координатах та же самая карта эллипсометрических углов, что и на рис. 3, б.

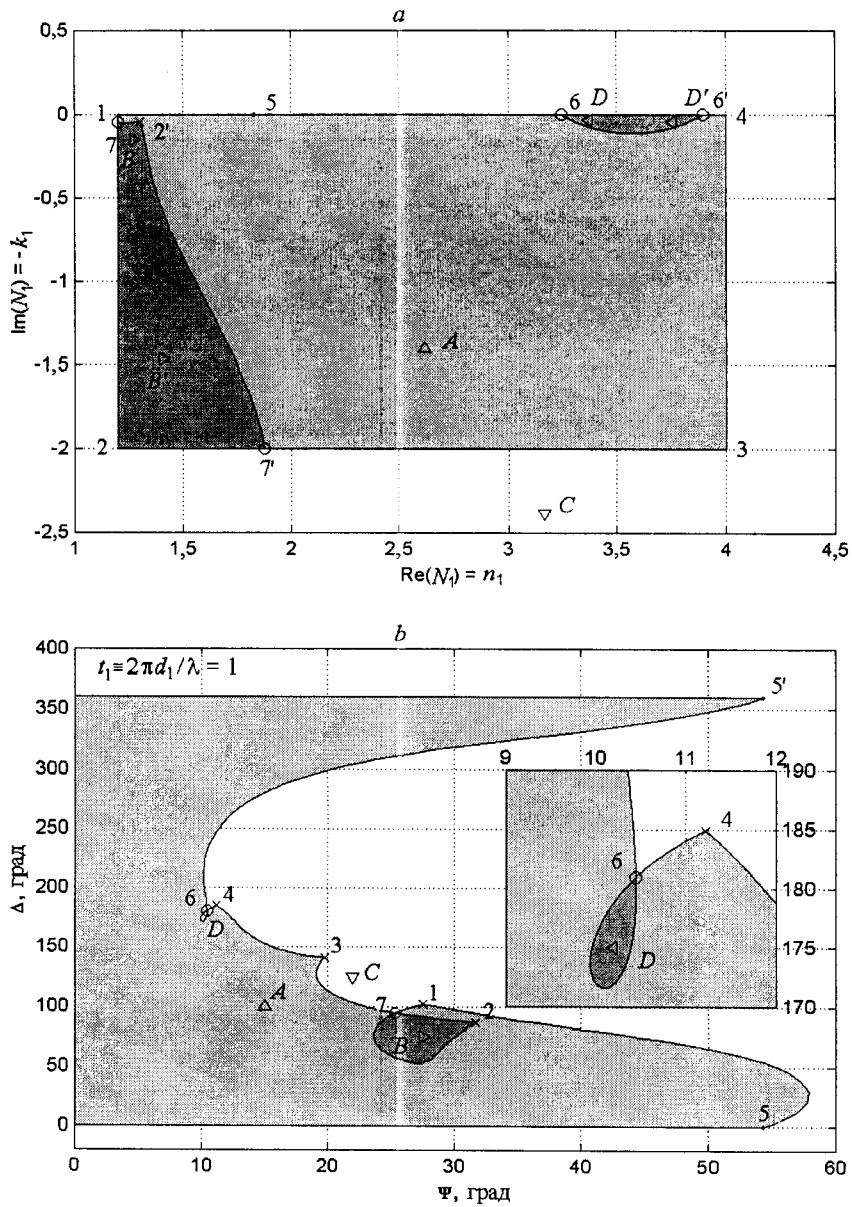
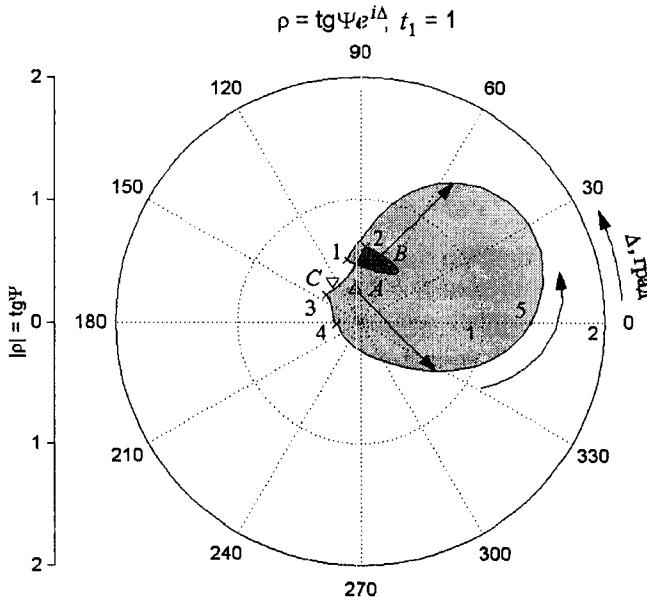


Рис. 3

Хорошо видно, что при обходе контура 1–2–3–4–1 функция $\operatorname{tg} \Psi e^{i\Delta}$ отображается также замкнутым контуром, внутренняя область которого соответствует внутренней области прямоугольника на $\operatorname{Re}(N_1)$ – $\operatorname{Im}(N_1)$ плоскости.

Итак, видно, что при отображении границы области, заданной на комплексной плоскости N_1 , на плоскость Ψ – Δ получается замкнутый контур, который делит плоскость Ψ – Δ на области с различным числом решений. Для более строгого анализа вопроса о количестве решений рассмотрим аналитические свойства функции ρ .



Rис. 4

2. Свойства ρ как функции комплексного переменного. В данной работе будем рассматривать ρ как функцию только комплексного показателя преломления N_1 пленки при фиксированных значениях остальных параметров системы:

$$\rho = \rho(N_1) \equiv \rho(n_1 - ik_1). \quad (2)$$

Очевидно, что эта функция определена и является аналитической на всей комплексной плоскости N_1 за исключением отдельных точек, где она имеет полюсы ($\rho \rightarrow \infty$, $\Psi \rightarrow 90^\circ$). Такие функции по определению называются мероморфными (или дробными) [12, § 7.6–7].

Вопрос нахождения всех корней функции $f(z)$ в ограниченной контуром C области значений аргумента z решается с помощью теоремы, известной как принцип аргумента [11, § 7.6–9], согласно которой число нулей N_C и число полюсов P_C функции $f(z)$ удовлетворяют соотношению

$$N_C - P_C = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta = \frac{\Delta_C \arg f(z)}{2\pi} \equiv R_C(f(z)), \quad (3)$$

где $\Delta_C \arg f(z)$ означает изменение аргумента $f(z)$ при обходе точкой z контура C в положительном направлении, а $R_C(f(z))$ – число полных оборотов вектора при обходе его концом замкнутого контура C с учетом направления обхода. Положительным считается направление, приводящее к увеличению аргумента, т. е. обход против часовой стрелки.

Применив эту теорему к функции $\rho - \rho_0$, где $\rho_0 = \operatorname{tg}\Psi_0 \exp(i\Delta_0)$ – значение функции ρ в точке, для которой необходимо найти решения, покажем, что число корней легко определить для любой точки на плоскости $\Psi - \Delta$. Для этого необходимо провести из искомой точки (например, A или B на рис. 4) вектор и сосчитать R_C – число оборотов вектора при обходе его концом

замкнутого контура 1–2–3–4–1. Определение числа оборотов R_C достаточно, если функция ρ не имеет полюсов в заданной области (т. е. $P_C = 0$), иными словами, не содержит точку $\Psi = 90^\circ$, для которой $\operatorname{tg} \Psi = \infty$. Если же функция ρ имеет полюсы ($P_C \neq 0$), то, согласно формуле (3), нужно прибавить число полюсов к числу оборотов вектора, чтобы определить полное число решений:

$$N_C(\rho - \rho_0) = R_C(\rho - \rho_0) + P_C(\rho - \rho_0). \quad (4)$$

На рис. 5 приведен пример отображения контура, показанного ранее на рис. 3, а, при толщине пленки $t_1 = 1,6$, когда функция ρ имеет полюс. Для удобства отображения здесь использованы другие координаты: $\Psi e^{i\Delta} \equiv (\Psi \cos \Delta + i \Psi \sin \Delta)$. В этих координатах вся комплексная плоскость отображается на круг радиусом 90° с примерным сохранением масштаба в центре ($\Psi \leq 45^\circ$).

Для всех точек в области I на рис. 5 обход контура происходит по часовой стрелке ($R_C = -1$), а для точек в области II – против часовой стрелки ($R_C = 1$), для всех точек в области III не совершается ни одного полного оборота ($R_C = 0$). Так как $N_C(\rho - \rho_0) \geq 0$, то из уравнения (4) вытекает, что $P_C \geq -R_C$, и, следовательно, наличие областей с $R_C < 0$ однозначно указывает на существование полюса.

Для определения числа решений в областях I–III следует знать число полюсов P_C . Очевидно, что число полюсов $P_C(\rho - \rho_0)$ не зависит от ρ_0 и определяется только областью искомых параметров. Следовательно, число оборотов R_C вокруг данной точки определяет число решений N_C с точностью до константы $P_C(\rho)$. Для определения этой константы можно предложить способ, основанный на представлении ρ в виде отношения двух целых (т. е. не имеющих полюсов) функций: $\rho = N/D$. Известно, что такое

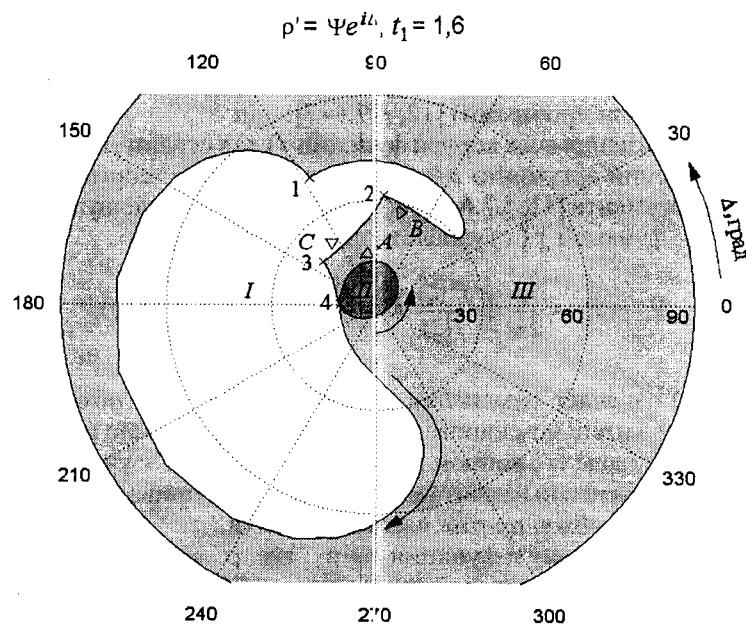


Рис. 5

представление существует для любой мероморфной функции [12, § 7.6–7]. Очевидно, что полюсы функции ρ совпадают с полюсами функции $1/D$, т. е. с нулями функции D : $P_C(\rho) = N_C(D)$. Применяя к функции D принцип аргумента, определим число ее нuleй и, следовательно, искомое число полюсов P_C функции ρ . Таким образом, для определения числа решений для всех точек на плоскости $\Psi - \Delta$ достаточно построить два отображения границы заданной на комплексной плоскости N_1 области: 1) на плоскость $\Psi - \Delta$ (в декартовых или полярных координатах) и 2) на плоскость D . С помощью первого отображения для любой точки $\Psi - \Delta$ определим соответствующее ей число оборотов $R_C(\Psi, \Delta)$, а с помощью второго – общее для всех Ψ и Δ число полюсов $P_C(\rho)$, которое, согласно (4), следует добавить к $R_C(\Psi, \Delta)$.

Возможен другой способ определения числа решений. Используя представление $\rho = N/D$, запишем

$$\rho - \rho_0 = N/D - \rho_0 = (N - \rho_0 D)/D \equiv \Phi/D. \quad (5)$$

Функция $\Phi = N - \rho_0 D$ как линейная комбинация целых функций не имеет полюсов, а ее нули совпадают с нулями функции $\rho - \rho_0$, т. е. с искомыми решениями. Число решений можно определить, применяя принцип аргумента к функции Φ . В этом случае нет необходимости находить отдельно число полюсов.

Достоинство первого способа состоит в том, что отображение контура C на плоскость $\Psi - \Delta$ (или на плоскость $\Psi e^{i\Delta}$) сразу определяет области с различным числом решений. Недостаток – необходимость отдельного определения числа полюсов. Этот способ удобен при графическом контроле решений задачи. Достоинство второго способа – непосредственное определение числа решений в данной точке (Ψ_0, Δ_0) . Недостаток – для каждой точки ρ_0 необходимо вычисление функции Φ на всем контуре.

В случае однослойной системы представление ρ в виде отношения двух целых функций N и D легко получить из хорошо известных выражений (см., например, [13, гл. 4]). Однако в данной работе мы пошли более простым путем. Заметим, что для применимости и первого, и второго способов достаточно, чтобы функции N и D не имели полюсов только в рассматриваемой области искомых параметров.

Если ни среда, ни пленка, ни подложка не являются усиливающими, т. е.

$$\operatorname{Im}(\varepsilon_0), \operatorname{Im}(\varepsilon_1), \operatorname{Im}(\varepsilon_s) \leq 0, \quad (6)$$

то по определению коэффициентов отражения $|Rp, s| \leq 1$. Следовательно, при выполнении условия (6) функции $R_p(N_1)$ и $R_s(N_1)$ не имеют полюсов и могут использоваться в качестве функций N и D . Таким образом, число полюсов $P_C(\rho)$ равно числу нuleй $R_s(N_1)$, а вспомогательная функция Φ в этом случае имеет вид: $\Phi(N_1) = R_p(N_1) - \rho_0 R_s(N_1)$.

Рис. 6, *a* и *b* иллюстрируют число решений для точек *A* и *B*, показанных на рис. 2, *b*; 3, *b* и 5, при изменении нормализованной толщины пленки t_1 от 0,1 до 2,0. Как видно из этих рисунков, число решений немонотонно зависит от толщины и принимает значения от 0 до 2. Для значений нормализованных толщин пленок $t_1 = 0,4, 1,0$ и $1,6$ число решений для обеих точек *A* и *B* согласуется с данными на рис. 2, *b*; 3, *b* и 5. На рис. 6, *c* и *d* для точек *C* и *D* показана зависимость числа решений от нормализованной толщины пленки t_1 в большем диапазоне изменения: от 0,2 до 10,0. Для этих точек следует

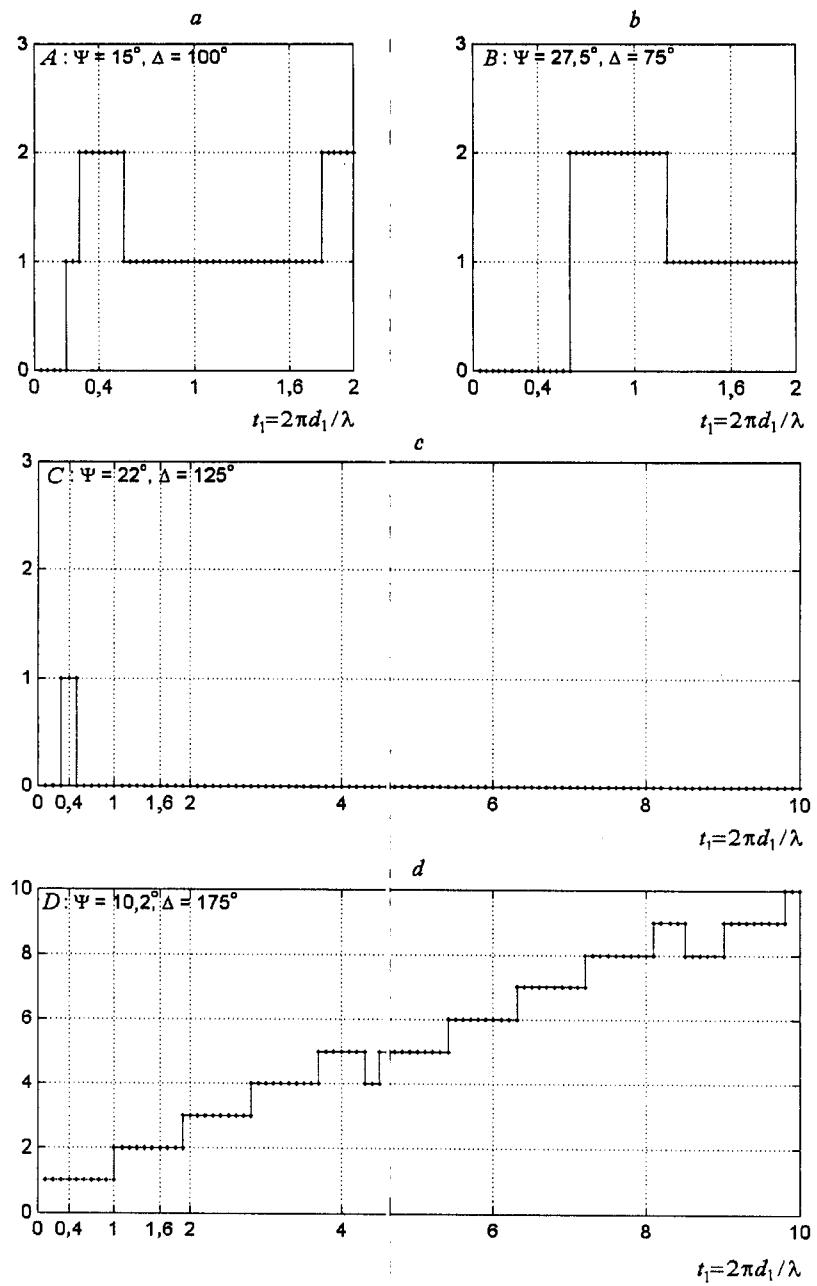


Рис. 6

отметить существенное различие в зависимостях количества решений от толщины. Более подробный анализ этих зависимостей и их различий выходит за рамки данной работы.

Заключение. Применение теории функций комплексного переменного для анализа основного уравнения эллипсометрии позволило предложить метод для определения общего числа решений ОЗЭ в заданном объеме иско-

мых параметров пленки. Очевидно, что этот метод полезен на начальных этапах решения конкретных обратных задач эллипсометрии.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 98-01-00965).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Spectroscopic Ellipsometry /Eds. A. C. Boccara, C. Pickering, J. Rivory. 1993. P. 244.
2. Kamiya I., Aspnes D. E., Tanaka H. et al. Surface science at atmospheric pressure: reconstructions on (001) GaAs in organometallic chemical vapor deposition // Phys. Rev. Lett. 1992. 68, N 5.
3. Martensson J., Arwin H. Interpretation of spectroscopic ellipsometry data on protein layers on gold including substrate-layer interaction // Langmuir. 1995. 11, N 3. P. 963.
4. Свиташева С. Н. Точное решение обратной задачи эллипсометрии для поглощающих пленок // ДАН СССР. 1991. 318, № 5. С. 1154.
5. Polovinkin V. G., Svitashova S. N. The analysis of general ambiguities of the inverse ellipsometric problem // Thin Solid Films. 1998. 313-314. P. 128.
6. Urban III F. K. Ellipsometry algorithm for absorbing films // Appl. Opt. 1993. 32, N 13. P. 2339.
7. Urban III F. K., Comfort J. C. Numerical ellipsometry: enhancement of new algorithm for real-time, in situ film growth monitoring // Thin Solid Films. 1994. 253. P. 262.
8. Comfort J. C., Urban III F. K. Numerical techniques useful in the practice of ellipsometry // Thin Solid Films. 1995. 270. P. 78.
9. Barton D., Comfort J. C., Urban III F. K. Numerical ellipsometry: Real-time solution using mapping onto the complex index plane // J. Vac. Sci. Technol. 1996. A14(3). P. 786.
10. Lekner J. Inversion of reflection ellipsometric data // Appl. Opt. 1994. 33, N 22. P. 5159.
11. Archer R. J. Determination of the properties of films on silicon by the method of ellipsometry // JOSA. 1962. 52, N 9. P. 970.
12. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. М.: Наука, 1973.
13. Аззам Р., Башара Н. Эллипсометрия и поляризованный свет. М.: Мир, 1981.

Поступила в редакцию 1 декабря 1998 г.